

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成20年5月29日(2008.5.29)

【公表番号】特表2008-511836(P2008-511836A)

【公表日】平成20年4月17日(2008.4.17)

【年通号数】公開・登録公報2008-015

【出願番号】特願2007-530286(P2007-530286)

【国際特許分類】

G 01 F 1/684 (2006.01)

【F I】

G 01 F 1/68 1 0 1 A

G 01 F 1/68 1 0 1 B

【手続補正書】

【提出日】平成20年4月2日(2008.4.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

流体の少なくとも1つの特性を検出するように構成された検出素子(2070)を、その上有する基板(2020)、

前記基板上に堆積され、1つ又は複数のガイド要素(2030)を画定する整合層、及び

流れチャネル(2040)、を備え、

前記ガイド要素(2030)が、前記検出素子(2070)の上有する前記流れチャネル(2040)を整合させる流量センサ(2010)。

【請求項2】

1つ又は複数の流体の物理的特性を測定するためのセンサ(2010)であって、実質的に固体絶縁性センサ本体及び複数の検出素子(2070)で構成されるセンサダイ、

前記センサダイに取り付けられ、前記検出素子(2070)の上有する複数の流れチャネル(2040)を画定する重合体基板(2020)、及び

前記流れチャネルに流体連通する複数の流管(20285)を備える、センサ。

【請求項3】

各々の流量センサ(2010)が検出素子(2070)に整合された流れチャネル(2040)を有する複数の流量センサ(2010)を製造する方法であって、

1つのパターンに整合された複数の検出素子(2070)を有する基板(2020)を提供するステップ、

前記基板(2020)上にガイド要素(2030)を形成するステップであって、各々のガイド要素(2030)が隣接する検出素子(2070)に整合されるステップ、及び

前記基板(2020)をダイシングして、各部片が検出素子(2070)及び少なくとも1つのガイド要素を有する複数の部片を形成するステップ、を含む方法。

【請求項4】

流量センサ(2010)を使用し複数の流体の1又はそれ以上の物理的性質を測定する方法であって、

(a) 流体の特性を少なくとも1つ検出するように構成される検出素子(2070)を

その上に有する基板(2020)、前記検出素子(2070)の上に整合された基準チャネルを画定する前記基板上の1つ又は複数のガイド要素(2030)、及び前記流管が前記検出素子を横切る流路を画定するように前記基準チャネル内に配設された第1の使い捨ての流管(20285)を含む流量センサ(2010)を提供するステップ、

(b) 第1の流体を前記第1の流管(20285)を通し前記検出素子(2070)を横切って導くステップ、

(c) 前記第1の流体の1つ又は複数の特性を検出するステップ、

(d) 前記基準チャネル(20240)から前記第1の流管(20285)を取り除くステップ、

(e) 前記基準チャネル(20240)内に前記第2の流管(20285)を配置するステップ、

(f) 前記第2の流管(20285)を通し、前記検出素子(2070)を横切って第2の流体を導くステップ、

(g) 前記第2の流体の1つ又は複数の特性を検出するステップ、並びに

(h) 追加流体のためにステップ(e)からステップ(g)を繰り返すステップ、を含む方法。